## 자동차용 고장력강판의 성형성 및 집합조직 특성 이강노<sup>†</sup>, 김동은, 황인석, 문만빈

현대하이스코 (hy720173@hysco.com<sup>†</sup>)

최근 각종 환경 규제와 자동차의안전성 증대를 위해 고장력 자동차 강판의 수요가 증대되고 있다. 차량의 많은 강판 비중을 차지하는 외판재의경우 안전성과 경량화를 위해서는 고장력강판이 유리하지만, 일반적으로 강도가 증가함에 따라 성형성이 감소되어자동차 생산에 커다란 문제를 야기 시킬 수 있다.

따라서 본 연구에서는 자동차용 고장력강판의 집합조직 제어를 통해 강도의 변화없이 성형성을 증대시키고 자, 고장력 자동차용 강판의 집합조직의 특징을 알아보는데 목적이 있다. 강판은γ-fiber (ND//[111]) 조직이 증가할수록 성형성의 증대를 가져올 수 있으며, 이는 압연과 열처리등의 공정 조건에 의해 제어된다. 자동차용고강도강판의 열처리는 연속소둔방식으로 행하였으며, XRD와 EBSD 등을통한 집합조직과 기계적인 특성을 분석하였다.

Keywords: 집합조직, 고장력강판, 자동차강판

( C-5 )

## 용액공정을 이용한 SiOC/SiO2 박막제조 김영희<sup>†</sup>, 김수룡, 권우택, 이정현, 유용현<sup>\*</sup>, 김형순<sup>\*</sup>

한국세라믹기술원; \*인하대학교 (yhkokim@kicet.re.kr<sup>†</sup>)

Low dielectric materials havebeen great attention in the semiconductor industry to develop high performance interlayer dielectrics with low k for Cu interconnect technology. In our study, the dielectric properties of SiOC /SiO2 thin film derived from polyphenylcarbosilanewere investigated as a potential interlayer dielectrics for Cu interconnect technology.

Polyphenylcarbosilane was synthesized fromthermal rearrangement of polymethylphenylsilane around 350°C~430°C.Characterization of synthesized polyphenylcarbosilane was performed with 29Si, 13C, 1H NMR, FT-IR, TG, XRD, GPC and GC analysis. From FT-IR data, the band at1035 cm-1 is very strong and assigned to CH2 bending vibration in Si-CH2-Sigroup, indicating the formation of the polyphenylcarbosilane. Number average ofmolecular weight (Mn) of the polyphenylcarbosilane synthesized at 400°C for 6hwas 2, 500 and is easily soluble in organic solvent.

SiOC /SiO2 thin film was fabricated onton-type silicon wafer by spin coating using 30wt % polyphenylcarbosilane incyclohexane. Curing of the film was performed in the air up to  $500^{\circ}$ C for 2h. The thickness of the film is ranged from 1 $\mu$ m to  $1.7\mu$ m.

The dielectric constant was determined from the capacitance data obtained from metal/polyphenylcarbosilane/conductive Si MIM capacitors and show a dielectric constant as low as 2.5 without addedporosity. The SiOC /SiO2 thin film derived from polyphenylcarbosilane shows promising application as an interlayer dielectrics for Cu interconnect technology.

Keywords: SiOC /SiO2 thin film, solution process, polyphenylcarbosilane